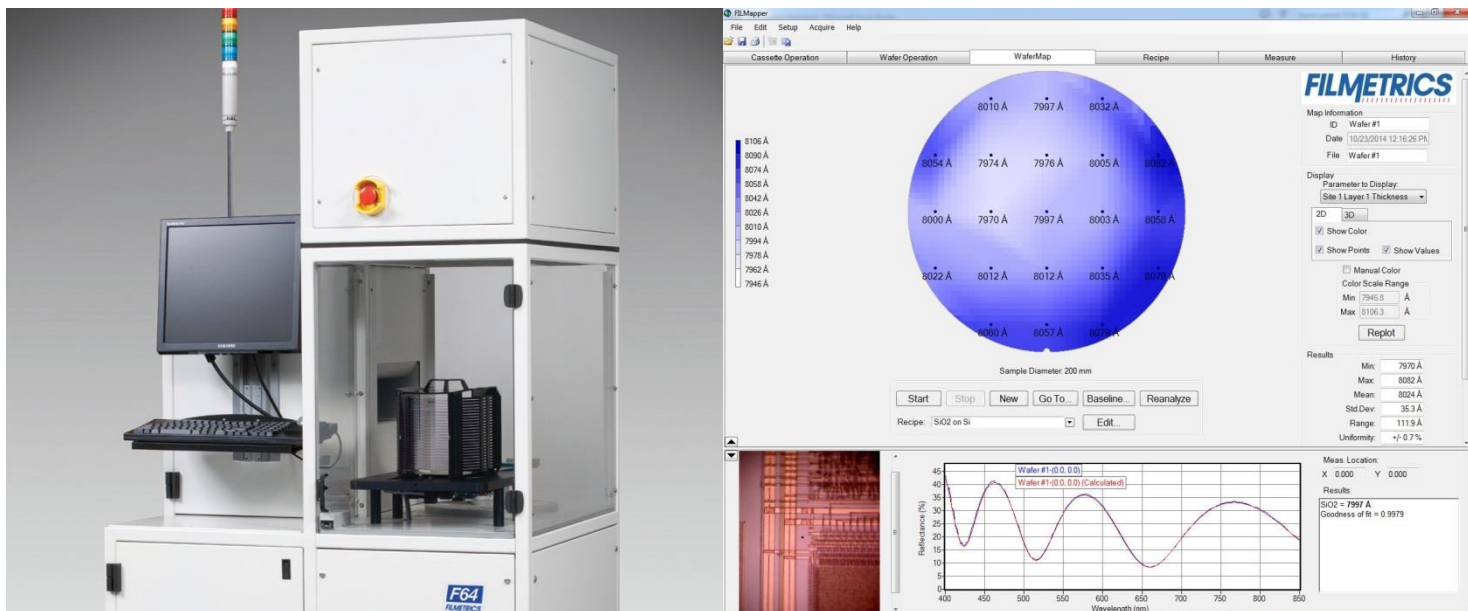


F64-c

薄膜厚度测量仪



晶片生产中自动化测量薄膜厚度分布图案系统

依靠 F64 先进的光谱反射系统，可以很简单快速地获得产品薄膜厚度及 n 和 k 值的分布图。利用图形识别软件控制高精度移动平台，自动寻找测试点，并以每个点约 1.5 秒快速生成厚度。机动化的转台能够最多配置四个物镜，方便选择多个不同尺寸的光斑。针对不同的晶圆尺寸，盒对盒系统可以很容易的自动转换，匹配当前盒子的尺寸。

可测样品膜层

基本上所有光滑的、透明半透明的或低吸收系数的膜层都可以测量。可测样品包括：

氧化硅	氮化硅	类金刚石 DLC
光刻胶	聚合物	聚亚酰胺
多晶硅	非晶硅	硅

斑点尺寸	500 微米 孔径	250 微米 孔径	100 微米 孔径	50 微米 孔径
5x 物镜:	100 μm	50 μm	20 μm	10 μm
10x 物镜:	50 μm	25 μm	10 μm	5 μm
15x 物镜:	33 μm	17 μm	7 μm	3.5 μm
50x 物镜:	10 μm	5 μm	2 μm	1 μm
100x 物镜:	5 μm	2.5 μm	1 μm	0.5 μm

Filmetrics 优势

- 桌面型薄膜厚度测量仪的全球领导者
- 24 小时电话、Email、在线技术支持
- 直观的分析软件

免费现场演示/支持

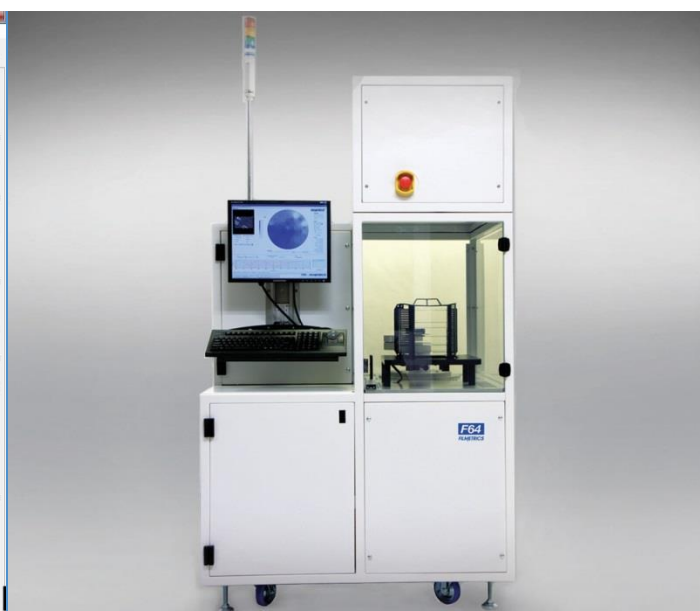
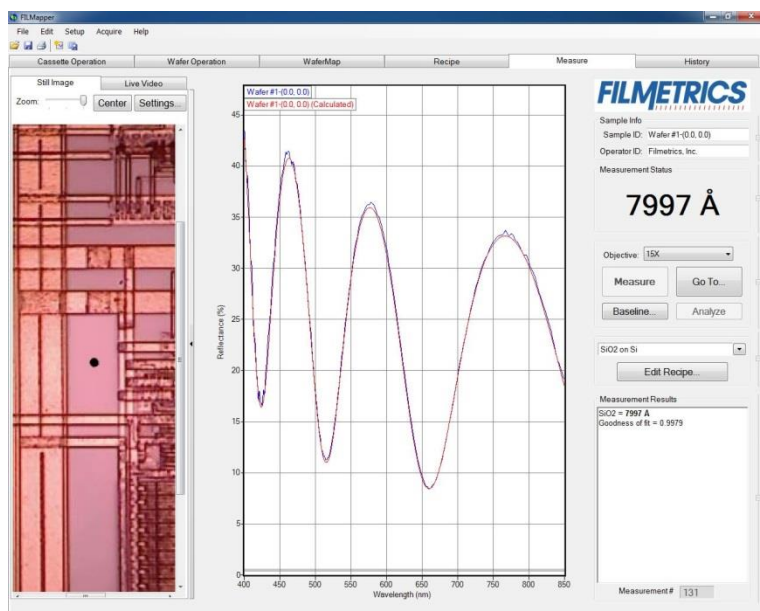
点几下鼠标就可以再网络上在线看到现场演示！请联系我们，我们的应用工程师会在电脑上为您演示薄膜测量是多么容易！

200mm 晶圆 25 个点的图案测量时间

	一次聚焦	每次聚焦
配有预对准器:	54 秒	84 秒
配有预对准器:	68 秒	98 秒

F64-c

薄膜厚度测量仪



测量规格	F64-c-UV	F64-c-UVX	F64-c	F64-c-EXR	F64-c-XXT
5x 物镜厚度范围*:	-	-	20 nm-40 μm	20 nm-120 μm	5 μm-1000 μm
10x 物镜厚度范围*:	-	-	20 nm-35 μm	20 nm-70 μm	-
15x 物镜厚度范围 4*:	3 nm-40 μm	3 nm-100 μm	20 nm-40 μm	20 nm-100 μm	-
50x 物镜厚度范围*:	-	-	20 nm-2 μm	20 nm-4 μm	-
100x 物镜厚度范围*:	-	-	20 nm-1.5 μm	20 nm-3 μm	-
测量 n 和 k 最小厚度要求 1*:	50 nm	50 nm	100 nm	100 nm	100 μm
准确度*: 大于 0.4%或	1 nm	1 nm	2 nm	2 nm	50 nm
精度 2:	0.02 nm	0.02 nm	0.02 nm	0.02 nm	5 nm
稳定性 3:	0.05 nm	0.05 nm	0.05 nm	0.05 nm	5 nm
基本规格					
光谱仪波长范围:	190-1100 nm	190-1700 nm	400-850 nm	400-1700 nm	1520-1580 nm
光源:	D2 + Halogen		Halogen		

基本要求	
晶圆尺寸:	100、125、200、和 300mm 晶片
选配:	晶圆预对准器 风机过滤机组-高效微粒子空气过滤器 用户可配置 3-4 种颜色的报警灯
尺寸 (cm) :	59"H(8cm),41"W(195cm),32"D(80cm) 配置预对准器: 56"W(143cm) 配置风机过滤机组: 72"H(180cm) 配置警报灯: 79"H(198cm)
重量:	基本系统: 205kg(450lbs) 配置预对准器: 增重 32kg(70lbs) 配置风机过滤机组: 增重 45kg(100lbs)
电源:	100-240VAC, 50-60Hz, 300W 真空泵: 25"Hg
操作系统	
PC :	Windows 7(64-bit)

提供定制化波长范围

* 取决于反射率

1 标准偏差为在 Si 基底上对厚度为 500 纳米的 SiO₂ 薄膜样品连续测量 100 次所得厚度值得标准偏差, 该值为连续 20 天测量的标准偏差的平均值。

2 2σ 是基于连续 20 天, 每天在基底 Si 上对厚度为 500 纳米的 SiO₂ 薄膜样品联系测量 100 次所得厚度值上得出。



优尼康科技有限公司

— Filmetrics 薄膜厚度测量系统专业代理商

联系方式: 李先生 15900490105

盘先生 15989637322

Email: Info@unicorn-tech.com

Web: www.unicorn-tech.com

内容如有更改, 恕不另行通知 ©2014 Filmetrics, Inc

